# 真空下粒子群の安息角

## 田谷 嘉浩,加賀 壽

## Angle of repose on particles under high vacuum

## Yoshihiro Taya and Hisashi Kaga

## 要 旨

高真空雰囲気下で安息角が測定できる装置を作製し、平均粒径450 $\mu$ mから40 $\mu$ mのガラス、銅、 アルミナ球形粒子について、大気圧から1×10<sup>-3</sup>Paの圧力下で測定した。その結果、真空下では大 気圧下に比べ安息角は小さくることがわかった。またその要因について、四重極型質量分析計により 残留ガスの分圧を測定し検討した結果、粒子に吸着しているH<sub>2</sub>Oの脱離が影響していることがわかっ た。

#### 1. 緒 言

真空は、粉体の乾燥や保存の手法として、従来 より一般的に利用されている。近年では、バルク 材を対象としていた CVD やスパッタ等による薄 膜形成など、高真空を利用した加工法を粉体に用 いるようになってきた。粉体にこれらの加工を行 う場合、粉体を撹拌などにより流動させる事が不 可欠である。

加賀ら<sup>1).2)</sup>は、粉体の機械的複合化の一手法 であるメカノフュージョンを、10<sup>-2</sup>Paオーダー の高真空下で行える装置を開発し、複合化に真空 が有効であると報告している。その中で、真空が 複合化に有効な理由の一つとして、高真空下のメ カノフュージョン処理では粉体表面からH<sub>2</sub>O,

CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>などのガスが発生し,それによる粒子 表面の清浄化をあげている。また吉野ら<sup>3)</sup>は,真 空下のメカノフュージョンにおいて,粒子の乾燥 による流動性向上を示唆しているが,明らかにさ れていない。この様に,真空中では材料表面から 吸着ガスの脱離や摩擦係数が増大する<sup>4)</sup>ことが知 られており,これらの現象は粉体の流動性に大き な影響を与えると思われる。しかしながら,真空 中の粉体の流動性に関する報告はほとんどないの が現状である。 流動性の指標として,安息角が手軽な方法とし て用いられる。そこで本研究では,大気圧から1 ×10<sup>-4</sup>Paの真空雰囲気下で安息角が測定できる 装置を作製し測定した。また,四重極型質量分析 計を用いた残留ガス分圧測定により,雰囲気圧力 が安息角に及ぼす影響を検討したので報告する。

#### 2. 実験方法

#### 2.1 試料

実験に用いた試料粉体の平均粒子径と真密度を 表1に、粒度分布及びSEM写真を図1及び図2 示す。試料は加熱等の乾燥は行わず、室温常圧で 保存した物をそのまま実験に用いた。

#### 表1 試料粉体の平均粒子径と真密度

試料粉体	ガラスビーズ A	ガラスビーズ B	ガラスビーズ C	アルミナ	銅
平均粒子径 (μm)	457	117	63	47	41
真 密 度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.49	2.49	2.47	3.77	8.93

-28 -



図1 試料粉体の粒度分布



図2 試料粉体のSEM 写真

2.2 実験装置



図3 実験装置の概略図

図3に実験装置の概略を示す。測定用真空室と 予備排気用ロードロック室は、それぞれ鍛造アル ミニウム及びステンレスで製作した。測定用真空 室の到達真空は1×10<sup>-4</sup>Paで、大気圧から1× 10<sup>-4</sup>Paの圧力下で実験が可能である。また、測 定用真空室には差動排気を用いた四重極型質量分 析計を付属し,分圧の測定が行えるようにした。

#### 2.3 実験方法

試料は、ガラスビーズとアルミナが150g、銅 については300gを100ccビーカーに自然落下にて 充填し、振動を与えないように表面を軽く均して ロードロック室に挿入した。その後、測定圧力が 1×10°Pa以上の時はロードロック室で測定圧力 まで排気し、測定圧力が1×10<sup>-1</sup>Pa以下では5 ×10<sup>-1</sup>Paまで予備排気をした。次に、予め測定 圧力になっている測定用真空室上部まで搬入し、 再度測定用真空室を測定圧力に調整した後ビーカー を回転させて試料を落下させ、安息角を測定した。 安息角の傾斜角度は、測定用真空室外部からデジ タルカメラで撮影したデジタル画像を、CAD に より計測した。図4に安息角測定中の一例を示す。 安息角の測定は、再現性のある物は3回それ以外 は6回行い平均をそれぞれの値とした。また,四 重極型質量分析計による測定用真空室の残留ガス 分圧測定は、試料落下直前に行った。



図4 安息角測定の一例

#### 3. 実験結果及び考察

安息角と測定雰囲気圧力の関係を図5に示す。 真空下の安息角は,全試料において大気圧に比 ベ小さくなった。銅を除くすべての粒子で低真空 の1×10<sup>4</sup>Paで急激に小さくなり,中真空では圧 力の低下とともに徐々に小さくなる。更に,高真 空である1×10<sup>-3</sup>Paで再び急激に小さくなる。



図6 測定用真空室の残留ガス分圧

図6に、四重極型質量分析計で測定した、試料 が無い測定用真空室と、粉体落下直前のアルミナ 試料が有る測定用真空室の残留ガス分圧を示す。 尚、分圧の値は測定値が差動排気により変換され た値であるため、測定用真空室圧力を全圧とした 値に換算した数値を使用した。全圧5×10<sup>3</sup>Paま で、各ガスは圧力につれ大気圧の分圧バランスの ままで低下する。全圧1×10<sup>3</sup>Pa近傍でH<sub>2</sub>O分 圧が上昇し、1×10<sup>1</sup>PaからはH<sub>2</sub>Oが支配的に なる。特にアルミナ試料が有る方のH<sub>2</sub>O分圧上 昇は、ない場合に比べ顕著である。これらの  $H_2O分圧上昇は、<math>H_2O$ の室温での蒸気圧が $1 \times 10^3$ Pa近傍にある<sup>5)</sup> こととよく一致する。



図7 測定用真空室のH<sub>2</sub>O分圧の比較

図7に、H<sub>2</sub>O分圧と、測定用真空室にアルミ ナ試料を入れた時のH<sub>2</sub>O分圧を比較した結果を 示す。試料が入っている測定用真空室内のH<sub>2</sub>O 分圧は、1×10<sup>2</sup>Paまでの低真空で数%程度多く、 試料からH<sub>2</sub>Oの脱離が起きていることが分かる。 1×10<sup>1</sup>Paから1×10<sup>-1</sup>Paまでの中真空では、 両者にあまり差はなく、1×10<sup>-2</sup>Pa以下の高真 空で再び試料の入った測定用真空室内のH<sub>2</sub>O分 圧が大きくなる。

以上のことから下記のことが考えられる。

安息角の1×104Paでの変化は、粒子表面の蒸 気圧で蒸発する付着水やエネルギーが弱い吸着水 が急激に脱離して、それに伴い粒子間の付着力が 大きく減少した結果と思われる。これに反し, 銅 に変化がみられなかったのは、吸着エネルギーが 弱い付着水が微少であったためと考えられる。中 真空中で変化が少ない理由として、低真空で脱離 した吸着水に比べ吸着エネルギーの強い吸着水が, 圧力に伴い徐々に脱離していった結果と思われる。 また、1×10<sup>-3</sup>Paで安息角が大きく変化するの は、低真空で徐々に脱離した吸着水が、この圧力 で脱離しやすくなった結果と思われる。海保ら6) は、安息角が付着水の2分子層吸着膜を形成する 水分まで一定でそれを越えると急激に上昇すると 報告している。このことから,上記の圧力変化に 伴う安息角の変化は、2分子層吸着膜より上部の 吸着水の脱離で起きたものと思われる。

今回の実験では,真空下粒子群の吸着水に着目 して検討を行った。しかし,本実験でも明らかな ように,真空下は乾燥雰囲気であるため,粒子群 の帯電も起きやすいと考えられる。今後,真空下 粒子群の帯電との相関についても検討が必要とさ れる。

## 4.結 言

本実験により以下のことがわかった。

真空下では圧力の低下に従って、安息角は小さく なる。その変化は、(1)大気から $1 \times 10^{3}$ Pa程度の 低真空、(2) $1 \times 10^{3}$ Paから $1 \times 10^{-2}$ Pa程度の中 真空、(3) $1 \times 10^{-2}$ Pa以下の高真空の各圧力範囲 により異なり、(1)(3)で大きく(2)で微少となる。こ れらの結果は、粒子表面吸着水の脱離が関与して いる。

### 参考文献

- 1)加賀 寿,田谷嘉浩,片山 博,濱口由和: 粉体及び粉末冶,39 (1992),P553.
- 加賀 寿,田谷嘉浩,片山 博,濱口由和: 粉体及び粉末冶,39 (1992), P1124.
- 3)吉野博之,田谷嘉浩,加賀 寿,向井田健一: 粉体工学会誌,,32,12(1995),P866~873.
- 4) 真空ハンドブック 改訂3版, アルバック・ コーポレートセンター編, P57.
- 5) 真空ハンドブック 改訂3版, アルバック・ コーポレートセンター編, P160~161.
- 6)海保 守,栗原現司,近沢正敏,金沢孝文: 粉体工学研究会誌,12,(1975) P324.